文部科学大臣賞

フェムト秒光周波数コムの時間コヒーレンス特性 を用いた新長さ計測法の提案

~次世代長さトレーサビリティーネットワークの実現に向けて~

東京大学大学院 工学系研究科 精密機械工学専攻 博士後期課程3年

韋 冬

1. はじめに

2009 年7月,日本における長さの国家標準はヨウ素安定化ヘリウムネオン(He-Ne)レーザ からフェムト秒光周波数コム(光周波数コム)へと変わった.その原因は、光周波数コム技術 により光周波数の測定が簡単になったことと、光周波数コムが持つ周波数安定性が従来にあ る長さの国家標準である He-Ne レーザが持つ周波数安定性と比べて 300 倍もよくなったこと にある [1].

本研究の必要性について考える.長さ計測及びそのトレーサビリティーは科学技術と生産 活動にとって不可欠な存在である.現状では,階層型の長さトレーサビリティーシステムの 中で,光周波数コム技術によりHe-Neレーザなどの周波数を校正し,長さ計測が常用長さ標 準であるHe-Neレーザやゲージブロックなどにより行われている.計測現場における計測精 度の向上を図るためには,長さの国家標準になった光周波数コムに直接リンクした長さ計測 技術を開発する必要がある.が,光周波数コムとHe-Neレーザとの性質は非常に異なってい る.具体的に,時間領域で見ると,光周波数コムはパルス列を発することに対して,He-Ne レーザは正弦波の形をした光を出力する.この違いが存在するために,一般によく使われる 長さの計測法であるマイケルソン干渉計においてその光源をHe-Neレーザから光周波数コム に変更しただけでは,より安定した周波数性能からより高精度の長さ計測が得られない.

このような背景を踏まえて、光周波数コムは一種のパルスレーザであることに注目し、パ ルスレーザを用いた長さ計測法を取り上げ、長さ標準である光周波数コムの時間コヒーレン ス特性を応用した長さ計測のモデルを構築し、高精度で任意かつ絶対的長さを計測できる方 法の提案及びその提案法の検証、またその不確かさの評価を実現する、ということが<u>本研究</u> の目的である。

光周波数コムは一種のパルスレーザであることから,パルスレーザを用いた長さ計測の従 来法を取り上げる.第一に,飛行時間(Time-of-flight:TOF)法がある.TOF法はパルスが計 測器から出た時間点とパルスが計測物体から反射されて帰ってくる時間点を記録する.両時 間点から計算された時間差と空気中の光速度との掛け算で測定器から計測物体までの距離を 計測する.第二に,パルス列干渉法[2,3]がある.この方法は光路差のアンバランスなマイ ケルソン干渉計において,異なるパルスによる時間領域での干渉現象を,パルス間にある離 散的距離の計測に応用した方法である.

<u>本研究のアイデア</u>は次のようになる. TOF 法は任意かつ絶対的長さ計測ができるが, その 計測精度はマイクロメートル程度である [4, 5]. パルス列干渉法は, TOF 法より良い精度を 有するが,離散的距離しか測定できない.異なるパルス列がお互いに干渉するため, TOF 法 に必要な両時間点を異なるパルス列の干渉により記録できるなら, 高精度で任意かつ絶対的 長さが測定できるであろう.

このアイデアを実現するためには具体的に,

(1) 「なぜ,異なるパルス列がお互いに干渉するのか」という問題に答えるために光周波数 コムの時間コヒーレンス関数に関するモデルを構築する

(2)「パルスの繰り返し間隔を用いて任意かつ絶対的な長さをどう表現するのか」という 問題に答えるために、パルス列間干渉による干渉縞の形成モデルを構築する.また、光周波 数コムの時間コヒーレンス特性を応用した長さ計測法を提案する

(3) 提案した長さ計測法を実証・評価する手法を考案し、ゲージブロックを用いた実証・

評価実験を行い,提案法の実現可能性を確認し,またその不確かさを評価する ことを目的として研究を行う.



図1. 光周波数コム. (a) 光周波数コム発生の模式図(左), 手作りの光周波数コム(右). (b) 時間領域における光周波数コム. (c) 周波数領域における光周波数コム.

2. 光周波数コムの時間コヒーレンス関数に関するモデルの構築

2.1. 概要

パルス列間に存在する干渉現象の基本となる光周波数コムの時間コヒーレンス関数を把握 する.

2.2. 詳細

2.2.1. 光周波数コム

簡単に光周波数コムについて紹介する.図1(a)に光周波数コム発生の模式図(左)と手造 りした発振器写真(右)を示す.励起にはレーザダイオード¹を用いる.レーザダイオード から出た光がエルビウムドープ非線形ファイバーをつないだリング共振器に入射させる.光 がリング共振器内を伝搬し,非線形ファイバーによる増幅・位相同期²・周波数同期³の過程 を経て、アウトプットで出力される.アイソレータは単一方向にだけ光を通す性質を持ち.

¹ 半導体の再結合発光原理を利用したレーザである.

² 各周波数成分が持つ位相を時間的にそろうことである.

³ 各周波数を時間的に安定させることである.

リング共振器内に逆方向に反射された光を防ぐ. 偏光板はリング共振器内の偏光を制御する. 圧電素子はリング共振器を構成する非線形ファイバーに巻いてある. 圧電素子の伸び縮みを利用して,発振周波数を制御する.

光周波数コムは一種のパルスレーザである.光周波数コムが非常に安定したパルス列を発 生し、その電場は下記のように表現できる [6].

$$E_{train}(t) = A(t) \exp(i\omega_c t + i(\varphi_0 + \Delta\varphi_{CE} t)) \otimes \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - mT_R)$$
(1)

ここでは, $E_{train}(t)$ は図 1(b) に示すパルス列の電場であり, ω_c はモードロックされた中心キャリヤ(角) 周波数であり, A(t) はパルスのエンベロープであり, そして φ_0 は任意の初期位相を表している. $\Delta \varphi_{cc}$ がパルスがレーザ共振器内部を1周するごとに形成されるキャリヤエンベロープオフセット位相である.

2.2.2. 光周波数コムが持つ時間コヒーレンス関数の導出 [7]

式(1)のフーリエ変換は図1(c)に示すコム状の周波数分布となり、下式のようになる.

$$\tilde{E}_{train}(f) = \tilde{A}(f - f_c) \times \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(f - mf_{rep} - f_{CEO})$$
⁽²⁾

*f*_{CEO} はオフセット周波数であり,等間隔に並んでいる光周波数コムの周波数成分は全体が *f*_{CEO} 分だけゼロ周波数からシフトしている.

式(2)から、光周波数コムのパワースペクトルは以下のようになる.

$$S(f) = \left|\tilde{E}_{rrain}(f)\right|^2 = \left|\tilde{A}(f - f_c)\right|^2 \times \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(f - mf_{rep} - f_{CEO})$$
(3)

ウィーナー・ヒンチン (Wiener-Khintchine) の定理に基づいて, 光周波数コムの時間コヒー レンス関数 $\gamma(\tau)$ は式 (3) の逆フーリエ変換より以下のように与えられる.

$$\gamma(\tau) \propto \mathbf{F}^{-1} \left[S(f) \right] \propto \mathbf{F}^{-1} \left[\left| \tilde{A}(f - f_c) \right|^2 \right] * \sum_{m = -\infty}^{+\infty} \delta(t - mT_R)$$
(4)

式(4)から光周波数コムのパルス間干渉による干渉信号は光周波数コムのレーザ光において伝播方向にパルスの反復期間と等間隔に存在することがわかる.

2.3. まとめ

光周波数コムから出たパルス列の波動方程式から出発して、光周波数コムが持つ時間コ ヒーレンス関数をモデル化した.結果として、まず、光周波数コムがコム状のパワースペク トルを持っていることが異なるパルス列の干渉原因であることが分かった.次に、パルス列 による干渉であることが分かった.そして、高い時間コヒーレンスピークは光周波数コムの 進行方向においてパルスの反復期間と等しい空間間隔で存在することがわかった.

3. 光周波数コムが持つ時間コヒーレンス特性を応用した長さ計測法

3.1. 概要

光周波数コムが持つ時間コヒーレンス特性を応用した長さ計測法の提案およびその提案法 の検証を行う.

3.2. 詳細

3.2.1. パルス列間干渉による干渉縞の形成モデルの構築

以下ではパルス列間干渉による干渉縞の形成モデルを構築する. 図2に示すマイケルソン 干渉計による光周波数コムのパルス列間干渉を考える. 光周波数コムから出たパルス列は ビームスプリッタ (BS) で,二つに分かれる. 一方のビームが固定されたミラー M₁, もう一 方のビームが移動可能なミラー M₂ でそれぞれ反射され, BS で再び重なる. フォトダイオー ド (PD) で両ビームによる干渉縞が検出される. PD で記録される干渉縞の強度分布は以下の ように与えられる.

$$I(l) \propto \left| E_{\text{train}}(l) \right|^2 \left| \gamma(l) \right| \cos(n \times \Delta \varphi_{\text{ce}})$$
(5)

ここで $n = \text{floor}(l_c T_R), l = l_R - l_O$ とし, c は真空中の光速度である.



図2. マイケルソン干渉計による干渉縞の形成.

 M_2 が光軸方向Zの異なる空間点に置 かれるとき,BSで両パルス列による電 場の重ねあわせとPDによって検出さ れた干渉縞をそれぞれ図3,4に示す. まず,図3(a)では M_2 が $Z_1(l_R=l_0)$ に置 かれた時,あるパルス列が自分自身と BSで重なり,PDで図4左に示すパル ス列の自己相関が記録される.

次に、図 3(b)(c) では M₂ が $Z_2(l_R=l_o + cT_R/2)$, $Z_3(l_R=l_o + cT_R)$ に置かれた時、あ るパルス列がそのパルス列とパルス間 隔ひとつ置き、または二つ置きに遅れ て帰ってくるパルス列と BS で重なり、 PD で図 4 中、右に示す位相がそれぞれ $\Delta \phi_{ce}$, 2× $\Delta \phi_{ce}$ (2× $\Delta \phi_{ce}$ < 2 π) ずれる干 渉縞が記録される.





図4. 光周波数コムの時間コヒーレンス (点線) とパルス干渉による干渉縞 (実線).

3.2.2. 従来にあるマイケルソン干渉計の問題点

光周波数コムを図2に示す従来にあるマイケルソン干渉計に入射した時に得られる干渉縞 を図4に示した.両光路のパルス列とパルス列とが重なった時しか干渉縞が形成されないた め,離散的な干渉縞しか観察できない.得られた干渉縞を解析することによって,パルス列 の繰り返し間隔に相当する長さ(またはその倍数)しかを得ることができない.言い換える と,<u>従来にあるマイケルソン干渉計に光周波数コムを光源として使った場合,離散的長さし</u> か計測できない.

3.2.3. 提案法 [8, 9]

本研究では単一の光周波数コムを用いて高精度で任意かつ絶対的長さ計測法を考案する. 第1節で述べたように,任意かつ絶対的長さを計測できる方法として TOF 法がある. TOF 法において時間差を判別する機構(例えば,オシロスコープや時間積分計数器など)が光信号 を電気信号に変換できる精度に制限されるため,TOF 法の計測精度がマイクロメートル程度 となっている.異なるパルス列間も干渉できることから.本研究では異なるパルス列間干渉 を用いて時間差を記録し,干渉縞解析により,時間差(つまり,長さ)を計測する方法を提案 する.提案法を「分離した多パルス列干渉縞を用いた長さ計測法」と呼ぶ.

3.2.3.1. 提案法の実現可能性の理論分析

周波数領域においてガウス関数の包絡線を持つ光周波数コムと仮定し, $c \times T_R$ (c は空気中の光速とする)分だけ繰り返すと, パルスとパルス間の位相は $\Delta \phi_{ee}$ だけ遅れることを考慮し, 図 5 に示す多パルス列干渉計に光周波数コムを入射させた場合, 光検出器で得られる干渉縞の強度は式 (5) を変形し, 下式のようになる [8].

$$I(l_{1}) = a_{1} + b_{1} \times \exp\left[-\left(2\sqrt{\ln 2}l_{1}/L_{coh}\right)^{2}\right] \times \cos(k \times l_{1} - \operatorname{mod}(\Delta\varphi_{ce}, 2\pi)) + a_{2} + b_{2} \times \exp\left[-\left(2\sqrt{\ln 2}(l_{1} + \Delta_{12})/L_{coh}\right)^{2}\right] \times \cos(k \times (l_{1} + \Delta_{12}) - \operatorname{mod}(N\Delta\varphi_{ce}, 2\pi)).$$
(6)

ここで, $a = I_{ref} + I_{obj}$, $b = 2\sqrt{I_{ref}I_{obj}}$, I_{ref} , I_{obj} はそれぞれ、参照鏡と物体鏡による反射された 光の強度を表す. L_{coh} は一つのパルスのコヒーレンス長である.



図 5. 提案法の模式図.

干渉縞から任意かつ絶対的長さLを推定するのが本研究の目的である.物体鏡間における 任意かつ絶対的距離 は関係式L = (N×c×T_R + Δ_{12})/2 で表現される.言い換えると,パル スの繰り返し間隔を長さの尺度として,その整数Nと端数 Δ_{12} との和でLが与えられる.両 干渉縞が分離できる時,干渉縞解析 [7]より式(6)で表す干渉縞から両干渉縞の包絡線のピー ク間の距離 Δ_{12} と両干渉縞間の相対的な位相遅れN× $\Delta \phi_{cr}$ が得られることが分かる.

提案法による高精度で任意かつ絶対的長さ計測の可能性を説明する. 光周波数コムの時間 パラメータと周波数パラメータとの間に以下の関係式で関連づけられている.

$$T_{\rm R} = 1/f_{\rm rep}$$
, $\Delta \varphi_{\rm ce} = 2\pi f_{\rm CEO}/f_{\rm rep}$ (7)

 T_{R} はパルスの繰り返し周期であり、 $\Delta \varphi_{ee}$ は T_{R} ごとにパルスの電場がエンベロープに対する位相のずれである.

オフセット周波数 f_{CEO} と繰り返し周波数 f_{rep} は光周波数コムを安定させるために使用される二つの主要パラメータであり、通常両者は 10⁻¹⁶ 程度安定される.まず、繰り返し周波数 f_{rep} が安定し、 T_R が安定する.これは、パルスの繰り返し間隔 c× T_R は高精度の長さ尺度として使えることを意味する.次に、オフセット周波数 f_{CEO} と繰り返し周波数 f_{rep} が安定し、モードロック技術により、 $\Delta \varphi_{ce}$ は安定する.そのため、両干渉縞間の相対的な位相遅れ N× $\Delta \varphi_{ce}$ が安定し、干渉縞解析から整数 N が求められる.そして、両干渉縞の時間コヒーレンスピーク間距離が Δ_{12} に対応し、フーリエ変換法 [7] より高精度で求められる.

このように,式(6)で表す分離できる干渉縞を解析すれば,NとΔ₁₂が求められ,両物体 鏡間の任意かつ絶対的距離を高精度で計算できる.この結論は,<u>提案法は高精度で任意か</u> つ絶対的長さ計測の可能性を有することである.

3.2.3.2. 提案法の実証・評価実験 [9]

以下では、提案法を実証・評価する手法(図 6)を考案し、呼び寸法 500 mm のゲージブロック3本を繋げた 1500 mm のゲージブロックを用いて実証・評価実験(図 7)を行い、提案法の 実現可能性を確認し、計測精度を評価する.

実証・評価実験の原理について説明する.実証・評価実験では、ゲージブロックの長さを 多パルス列干渉による干渉縞で記録し、記録された干渉縞を解析し、求めた計測値とゲージ ブロックの(メーカーによる)校正値との比較実験を行う.

3.2.3.3. 実験結果

以下では実証・評価実験の実験結果を説明する.

まず、ゲージブロックの(メーカーによる)校正値の計測について説明する.

ゲージブロックの(メーカーによる)検査成績書により、3本のゲージブロックの中央寸法 の寸法差はそれぞれ、-0.42µm、-0.50µmと-0.51µmである. 計測開始時におけるゲージブ ロックの温度は23.5765 ℃であるため、温度補正を考慮し、計測比較対象であるゲージブロッ クの長さは1.500056655 mと計算される. このように計算し、実験を繰り返し行い、温度補 正したゲージブロックの平均長の校正値は、1.500056289 mとなる. この測定の標準偏差は 242 nmであった.



図6.実証・評価システムの模式図.



図 7. 実証・評価システム. (a) 光学実験の写真. (b) 温度計及び気圧計. (c) 観察された干渉縞.

次に,分離した多パルス列干渉縞を用いた長さ計測法による空気中での長さ計測について 述べる.

第 3.2.3.1 節で述べたように,任意かつ絶対距離 L は L = (N × c × T_R + Δ_{12}) /2 である. 第一に,下式のように N × c × T_R /2 の部分を考える.

$$N \times c \times T_{\rm R}/2 = c/(2 \times n_{\rm g} \times f_{\rm rep}) \tag{8}$$

ここで, c は真空中の光速度で 299,792,458m/s である.また,計測対象の長さは約 1.5 m 前後にあるため, N = 1 である. n_g は各回の計測時,実験環境における空気の屈折率であ る.例えば,第1回目の計測では, n_g を計算するために実験開始時の気圧 1001.1 hPa,気温 23.00 ℃を使い,空気の湿度は 50% とした. Edl' en の式に従うと, n_g は 1.000262147 となる. また,光周波数コムの繰り返し周波数 f_{rep} は正確な 100 MHz ± 1 Hz である.これらの値を 式 (8) に代入し, N×c×T_R/2 の部分は 1.498569445 m と計算される.

第二に, Δ₁₂/2の部分を考える.図7(c)に示す観察され干渉縞に対してフーリエ変換法[7] よりデータ処理を行い, Δ₁₂/2は0.001523825 mと計算される.

第三に、整数Nと端数 Δ_{12} との和を求める.提案法により計測された長さLはL=(N×c×T_R + Δ_{12})/2=1.498569445 + 0.001523825 = 1.500064237 m となる.

このように計算し,実験を繰り返し行い,提案法による長さ測定値は,1.500062583 mとなる.この測定の標準偏差は1672 nm であった.また,ゲージブロックの校正値との差は6294 nm である.

3.3. まとめ

まず,パルスの繰り返し間隔を長さの尺度として,任意かつ絶対的長さの表現法を提案した.また,通常のマイケルソン干渉計と光路差のアンバランスなマイケルソン干渉計を組み 合わせた光学設計より多パルス列干渉を考え,<u>多パルス列干渉による干渉編の形成を分析</u> し、フェムト秒光周波数コムによる高精度で任意かつ絶対的長さの測定方法を研究した.

次に、分離した多パルス列干渉縞による絶対距離測定の分析では、両干渉縞の時間コヒー レンス関数ピーク間距離と、干渉縞のキャリヤ位相差を計測し、距離を推定できることを考 察し、それに基づく「分離した多パルス列干渉縞を用いた長さ計測法」を提案した.

そして,提案法を実証・評価するために,呼び寸法 500 mm のゲージブロック 3 本を密着 法によって繋げた 1500 mm のゲージブロックを用いて,実証・評価実験をした.提案法に より得られた長さとゲージブロックの(メーカーによる)校正値の比較を行い,提案法の実現 可能性を実証した.

最後に,繰り返し実験を行い,提案した実証・評価実験システムがもつ不確かさを確かめ, マイクロメートルの精度でメートルオーダーの長さ計測比較実験を用いて,提案法の計測精 度を評価した.

4. 結論と今後の展開

本研究を総括し、結論は次のようになる.

本研究は、パルスレーザを用いた長さ計測法を取り上げ、長さ標準である光周波数コムの 時間コヒーレンス特性を応用した長さ計測のモデルを構築し、光周波数コムを使用した高精 度で任意かつ絶対的長さ計測法の提案及びその提案法の検証、またその不確かさの評価を実 現した.

本研究のオリジナリティを下記のテーブルにまとめる.

節	問題	オリジナリティ
2 節	異なるパルス列がなぜ干渉す	光周波数コムがコム状のパワースペクトルを
	るのか.	持つが干渉の原因である.
3 節	パルス列を用いてどのように	パルスの繰り返し間隔による長さの表現法を
	長さを表現するのか. どのよう	考案し、離散した多パルス列干渉による干渉
	に測長に結び付けるのか.	縞の解析を用いた長さ計測法を提案した.
3 節		ゲージブロックを用いた実証・評価実験シス
	どのように提案法を実証・評価	テムで提案法の実現可能性を確認し、マイク
	するのか.	ロメートルの精度でメートルオーダーの長さ
		計測により,提案法の計測精度を評価した.

表1. 本研究のオリジナリティ.

今後は、測定精度を向上させるためには、空気や光学部品による影響を配慮したパルスの 伝搬モデルを考える必要性はある.また、キャリヤ位相ずれΔφ_{CE}を制御し、空気中及び宇 宙区間で、高精度で任意かつ絶対的長さ計測への応用まで検討する予定である.

光周波数コムの中心周波数は1560 ナノメートルにあり,光の損失が低いため,光ファイ バーで光周波数コムを製造工場や測定室などに配信できる [10]. 光周波数コムを使用した高 精度で任意かつ絶対的長さ計測法が実現されれば,いつでもどこでもだれでも長さの国家標 準にアクセスできることを意味する. これは従来にある階層型の長さトレーサビリティーシ ステムにおいては考えられないことであり,計測現場における長さ計測の精度は格段に上が り,科学研究や生産活動にこれまでにない大きなインパクトを与えるであろう.

最後に,近い将来,多パルス列干渉を活用した高精度で任意かつ絶対的長さ計測及びそれ による次世代長さトレーサビリティーネットワークの実現を思い描く.

謝辞

本研究を行うに当たり,日々ご指導いただいている高増潔教授,高橋哲准教授,及び, 松本弘一特任教授に心より感謝申し上げます.

参考文献

- AIST, ""National standard of length": to the new method [In Japanese], 2010, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), JAPAN, accessed 18 June 2010, http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2009/pr20090716/pr20090716.html." (2010).
- 2. R. Illingworth and I. S. Ruddock, Optics Communications 59, 375-378 (1986).
- 3. A. M. Chekhovsky, A. N. Golubev, and M. V. Gorbunkov, Applied Optics 37, 3480-3483 (1998).
- 4. T. Araki, Review of Scientific Instruments 66, 43-47 (1995).
- A. Kilpela, R. Pennala, and J. Kostamovaara, Review of Scientific Instruments 72, 2197-2202 (2001).
- 6. F. Helbing, G. Steinmeyer, and U. Keller, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics **9**, 1030-1040 (2003).
- 7. D. Wei, S. Takahashi, K. Takamasu, and H. Matsumoto, Opt. Express 17, 7011-7018 (2009).
- 8. D. Wei, S. Takahashi, K. Takamasu, and H. Matsumoto, Japanese journal of applied physics **50**, 022701 (2011).
- 9. D. Wei, S. Takahashi, K. Takamasu, and H. Matsumoto, Opt. Express 19, 4881-4889 (2011).
- 10. 計量器校正情報システム (e-trace) 技術開発事業, NEDO, Japan, accessed 30 Aug, 2010, http://www.nedo.go.jp/kengyou/etrace/index.html